

Title (en)

MEMS SWITCH, METHOD OF MANUFACTURING A MEMS SWITCH AND DEVICE

Title (de)

MEMS-SCHALTER, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MEMS-SCHALTERS UND VORRICHTUNG

Title (fr)

COMMUTATEUR MEMS, PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN COMMUTATEUR MEMS ET DISPOSITIF

Publication

EP 3929960 A1 20211229 (DE)

Application

EP 20182568 A 20200626

Priority

EP 20182568 A 20200626

Abstract (de)

MEMS-Schalter (1) mit einem Biegeelement (150) und einem an dem Biegeelement angeordneten Schaltkontakt (120) sowie mit einem Gegenkontakt (250), wobei vom Biegeelement (150) eine Anlagestellung einnehmbar ist, in welcher der Schaltkontakt (120) am Gegenkontakt (250) in Anlage ist, wobei das Biegeelement (150) in die Anlagestellung vorgespannt ist. Bei dem Verfahren zur Herstellung eines solchen MEMS-Schalters (1, 300) wird das Biegeelement (150) in die Anlagestellung vorgespannt.

IPC 8 full level

H01H 57/00 (2006.01); **H01H 37/00** (2006.01); **H01H 1/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01H 57/00 (2013.01); **H01H 2001/0084** (2013.01); **H01H 2037/008** (2013.01); **H01H 2057/006** (2013.01)

Citation (applicant)

DE 102017215236 A1 20190228 - SIEMENS AG [DE]

Citation (search report)

- [XA] US 2012325630 A1 20121227 - PULSKAMP JEFFREY S [US], et al
- [XAY] WO 9943013 A1 19990826 - SIEMENS AG [DE], et al
- [XAY] EP 2398028 A2 20111221 - GEN ELECTRIC [US]
- [YA] US 6229684 B1 20010508 - COWEN ALLEN BRUCE [US], et al
- [YDA] DE 102017215236 A1 20190228 - SIEMENS AG [DE]

Cited by

EP4075469A1; EP4002407A1; EP4057317A1; WO2022189128A1

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 3929960 A1 20211229

DOCDB simple family (application)

EP 20182568 A 20200626